(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-197444

(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.Cl.⁶

G01N 21/35

21/61

識別記号

FΙ

G 0 1 N 21/35

21/61

Z

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-4845

(71) 出願人 000206956

大塚製薬株式会社

(22)出願日 平成9年(1997)1月14日

東京都千代田区神田司町2丁目9番地

(72)発明者 森 正昭

大阪府枚方市杉山手1-20-18

(72)発明者 久保 康弘

滋賀県甲賀郡甲西町菩提寺2093番地の211

(72)発明者 筒井 和典

大阪府枚方市楠葉面取町1丁目15-2-

202

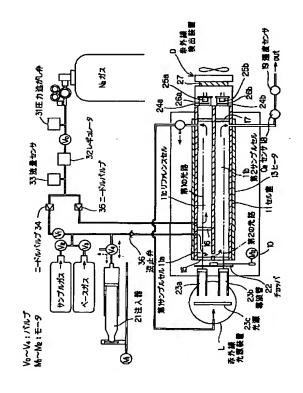
(74)代理人 弁理士 亀井 弘勝 (外1名)

(54) 【発明の名称】 同位体ガス分光測定方法

(57)【要約】

【課題】複数の成分ガスを含む被測定ガスをセルに導き、分光測定をする場合に、成分ガスの構成を変えないように希釈することによって、成分ガスの濃度を精密に測定する。

【解決手段】1つの検体から収集された2種類の被測定ガスについて、一方の被測定ガスのCO、濃度が他方の被測定ガスのCO、濃度よりも高ければ、CO一方の被測定ガスのCO、濃度が他方の被測定ガスのCO、濃度に等しくなるまでバルブV、を通して一方の被測定ガスを空気(大気)で希釈して、被測定ガスの濃度比 ^{12}CO 、を測定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】二酸化炭素''CO、と二酸化炭素''CO、とを成分ガスとして含む被測定ガスをセルに導き、各成分ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、既知の濃度の成分ガスを含むガスを測定することによって作成された検量線を用いて、各成分ガスの濃度を測定する同位体ガス分光測定方法において、

1つの検体から収集された2種類の被測定ガスについて、一方の被測定ガスのCO、濃度が他方の被測定ガスのCO、濃度よりも高ければ、この一方の被測定ガスの 10 CO、濃度が他方の被測定ガスのCO、濃度に等しくなるまで一方の被測定ガスを空気で希釈して、各被測定ガスの濃度比¹³CO、/¹²CO、を測定する同位体ガス分光測定方法。

【請求項2】二酸化炭素1'CO, と二酸化炭素1'CO, とを成分ガスとして含む被測定ガスをセルに導き、各成 分ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、既知の濃 度の成分ガスを含むガスを測定することによって作成さ れた検量線を用いて、各成分ガスの濃度を測定する同位 体ガス分光測定方法において、予備測定において、(a) 1つの検体から収集された2種類の被測定ガスについ て、第1種類の被測定ガスのCO、濃度と、第2種類の 被測定ガスのCO、濃度をそれぞれ測定し、本測定にお いて、(b) 測定された第1種類の被測定ガスのCO、濃 度が測定された第2種類の被測定ガスのCO、濃度より も高ければ、この第1種類の被測定ガスのCO、濃度が 第2種類の被測定ガスのCO、濃度に等しくなるまで第 1種類の被測定ガスを空気で希釈した後、第1種類の被 測定ガスの濃度比13CO、/13CO、を測定し、(c) 第 2 種類の被測定ガスの濃度比¹¹ C O, /¹¹ C O, を測定 30 する同位体ガス分光測定方法。

【請求項3】二酸化炭素1'CO, と二酸化炭素1'CO, とを成分ガスとして含む被測定ガスをセルに導き、各成 分ガスに適した波長の透過光の吸光度を求め、既知の濃 度の成分ガスを含むガスを測定することによって作成さ れた検量線を用いて、各成分ガスの濃度を測定する同位 体ガス分光測定方法において、予備測定において、(a) 1つの検体から収集された2種類の被測定ガスについ て、第1種類の被測定ガスのCO、濃度と、第2種類の 被測定ガスのCO、濃度をそれぞれ測定し、本測定にお いて、(b) 測定された第1種類の被測定ガスのCO、濃 度が測定された第2種類の被測定ガスのCO, 濃度より も低ければ、第1種類の被測定ガスの濃度比11CO。/ 11 CO, をこのまま測定し、(c) 第2種類の被測定ガス のCO, 濃度が第1種類の被測定ガスのCO, 濃度に等 しくなるまで第2種類の被測定ガスを空気で希釈した 後、第2種類の被測定ガスの濃度比13CO。/12CO。 を測定する同位体ガス分光測定方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】同位体の入った薬物を生体に 投与した後、同位体の濃度変化、又は濃度比の変化を測 定することにより、生体の代謝機能を測定することがで きるので、同位体の分析は、医療の分野での病気の診断 に利用されている。また、医療の分野以外でも、同位体 の分析は、光合成の研究、植物の代謝作用の研究に利用 され、地球化学分野では生態系のトレースに利用されて いる。。

【0002】本発明は、同位体の光吸収特性の相違に着目して、同位体ガスの濃度を測定する同位体ガス分光測 定方法に関するものである。

[0003]

【従来の技術】一般に、胃潰瘍、胃炎の原因として、ストレスの他に、ヘリコバクタピロリー(HP)と言われているバクテリアが存在することが知られている。患者の胃の中にHPが存在すれば、抗生物質の投与等による除菌治療を行う必要がある。したがって、患者にHPが存在するか否かを確認することが重要である。HPは、強いウレアーゼ活性を持っていて、尿素を二酸化炭素と20アンモニアに分解する。

【0004】一方、炭素には、質量数が12のものの他、質量数が13や14の同位体が存在するが、これらの中で質量数が13の同位体¹³Cは、放射性がなく、安定して存在するため取扱いが容易である。そこで、同位体¹³Cでマーキングした尿素を生体に投与した後、最終代謝産物である患者の呼気中の¹³CO、の濃度、具体的には¹³CO、と¹²CO、との濃度比を測定することができれば、HPの存在を確認することができる。

【0005】ところが、13CO、と12CO、との濃度比は、自然界では1:100と大きく、このため患者の呼気中の濃度比を精度よく測定することは難しい。従来、13CO、と12CO、との濃度比を求める方法として、赤外分光を用いる方法が知られている(特公昭61-42219号、特公昭61-42220号公報参照)。

【0006】特公昭61-42220号記載の方法は、 長短2本のセルを用意し、一方のセルでの¹³CO」の吸収と、一方のセルでの¹²CO」の吸収とが等しくなるようなセルの長さにし、2本のセルを透過した光を両方のセルに導いて、それぞれ最大感度を実現する波長での光強度を測定する方法である。この方法によれば、自然界の濃度比での光吸収比を1にすることができ、これから濃度比がずれると、ずれた分だけ光吸収比がずれるので、光吸収比の変化を知って濃度比の変化を知ることができる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】赤外分光測定においては、投与前の呼気について、1'CO,の吸光度を測定して、1'CO,用の検量線を使って1'CO,濃度を算出し、1'CO,の吸光度を測定して、1'CO,用の検量線50を使って1'CO,濃度を算出する。投与後の呼気につい

ても同様の測定をしている。

【0008】 このとき、CO、 濃度が2種類の呼気につ いてほぼ同じならば、「「CO」の検量線や「「CO」の検 **重線を使う範囲を狭くすることができる。したがって、** 検量線を使う範囲を限定することによって、測定精度を 上げることができる。CO、濃度を等しくするために は、いずれかの呼気を希釈しなければならないが、希釈 するガス(以下「希釈ガス」という)として、通常、窒 素ガスのような赤外領域に吸収を持たないガスを使用す ることが考えられる(本願の先願である特開平8-58 052号の発明の実施の形態では、希釈ガスとして窒素 ガスを使用している)。

【0009】しかし、この希釈方法では、希釈された呼 気には希釈ガスが混じっているので、希釈されないほう の呼気との構成ガスの成分比率が異なったものになる。 この結果、前記成分比率の相違が呼気中の13CO、濃度 や、13CO、と12CO、との濃度比の測定に影響を及ぼ すことになり、測定値に誤差の入る要因となる。

【0010】そこで、本発明は、複数の成分ガスを含む 被測定ガスをセルに導き、分光測定をする場合に、呼気 20 の成分ガスの構成を変えないように希釈することによっ て、成分ガスの濃度を精密に測定することができる同位 体ガス分光測定方法を実現することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記の目的を達成するた めの請求項1記載の同位体ガス分光測定方法は、1つの 検体から収集された2種類の被測定ガスについて、一方 の被測定ガスのCO、濃度が他方の被測定ガスのCO、 濃度よりも高ければ、この一方の被測定ガスのCO、濃 度が他方の被測定ガスのCO、濃度に等しくなるまで― 30 方の被測定ガスを空気(大気)で希釈して、各被測定ガ スの濃度比13 CO、/12 CO、を測定する方法である。 【0012】この方法によれば、CO、濃度が等しいと いう条件で、2種類の呼気をそれぞれ測定することがで きるので、使う検量線の範囲を限定することができる。 しかも、希釈ガスとして空気を用いるので、希釈によっ ても呼気の成分ガスの構成は変わらない。この結果、測 定精度を上げることができる。請求項2又は3記載の方 法は、いずれも単一のセルに、第1種類の被測定ガスを 満たして光量を測定し、排出した後、第2種類の被測定 40 ガスを満たして光量を測定することを前提にした、請求 項1記載の同位体ガス分光測定方法の具体的手順を示し ている。

[0013]

【発明の実施の形態】以下、同位体13Cでマーキングし たウレア診断薬を人間に投与した後、呼気中のいての、 濃度比を分光測定する場合の、本発明の実施の形態を、 添付図面を参照しながら詳細に説明する。

1. 呼気テスト

まず、ウレア診断薬を投与する前の患者の呼気を呼気バ 50 【0018】第2サンプルセル11bから導出される排

ッグに採集する。呼気バッグの容量は、250ml程度 である。その後、ウレア診断薬を経口投与し、10-1 5分後、投与前と同様の方法で他の呼気バッグに呼気を 採集する。

【0014】投与前と投与後の呼気バッグをそれぞれ同 位体ガス分光測定装置の所定のノズルにセットし、以下 の自動制御を行う。

II. 同位体ガス分光測定装置

図1は、同位体ガス分光測定装置の全体構成を示すブロ ック図である。投与後の呼気(以下「サンプルガス」と いう)を採集した呼気バッグと投与前の呼気(以下「ベ ースガス」という)を採集した呼気バッグとはそれぞれ ノズルにセットされる。ベースガスを採集した呼気バッ グは、樹脂又は金属パイプ(以下単に「パイプ」とい う)を通してバルブV, につながり、サンブルガスを採 集した呼気バッグは、パイプを通してバルブV、につな がっている。

【0015】一方、ガスボンベからリファレンスガス (測定対象波長域に吸収のないガスであれば何でもよ い。例えば窒素ガス)が供給されている。リファレンス ガスは圧力逃がし弁31、バルブV。、レギュレータ3 2、流量計33を通して、一方はニードルバルブ35を 通してリファレンスセル11cに入り、他方はバルブV 1、逆止弁36を通して1200、の吸収を測定するため の第1サンプルセル11aに入る。

【0016】さらに、バルブV、と第1サンプルセル1 laとの間には、サンプルガス又はベースガスを定量的 に注入するためのガス注入器21(容量70cc)が、 三方バルブV、を介してつながれている。このガス注入 器21は、ピストンとシリンダーを有する注射器のよう な形状のもので、ビストンの駆動は、モータM1と、モ ータM、に連結された送りネジと、ピストンに固定され たナットとの共働によって行われる。

【0017】セル室11は、図1に示すように、12CO , の吸収を測定するための短い第1サンプルセル11 a、13CO。の吸収を測定するための長い第2サンプル セル11b及びリファレンスガスを流すリファレンスセ ル11cからなり、第1サンプルセル11aと第2サン プルセル11bとは連通しており、第1サンプルセル1 1 a に導かれたガスは、そのまま第2 サンプルセル11 bに入り、排気されるようになっている。また、リファ レンスセル11cにはリファレンスガスが導かれ、リフ ァレンスガスは、リファレンスセル11cを通り抜けた 後は、一方はセル室11を収納するケース10内を通 り、他方は赤外線光源装置しを通り、それぞれ排気され る。第1サンプルセル11aの長さは具体的には13m mであり、第2サンプルセル11bの長さは具体的には 250mmであり、リファレンスセル11cの長さは具 体的には236mmである。

気管には、O, センサ18及び湿度センサ19が設けられている。このO, センサ18には、市販の酸素センサを用いることができる。例えばジルコニアセンサ等の固体電解質ガスセンサ、ガルバニ電池式センサ等の電気化学ガスセンサを使用することができる。湿度センサ19には、市販の湿度センサを用いることができ、例えば多孔質セラミックやポリマー抵抗体を使用したセンサがある。

【0019】赤外線光源装置しは赤外線を照射するための2つの導波管23a,23bを備えている。赤外線発 10生の方式は、任意のものでよく、例えばセラミックスヒータ(表面温度450℃)等が使用可能である。また、赤外線を一定周期でしゃ断し通過させる回転するチョッパ22が設けられている。赤外線光源装置しから照射された赤外線のうち、第1サンプルセル11a及びリファレンスセル11cを通るものが形成する光路を「第1の光路」といい、第2サンプルセル11bを通るものが形成する光路を「第2の光路」という。

【0020】符号Dは、セルを通過した赤外線を検出する赤外線検出装置を示している。赤外線検出装置Dは、20第1の光路に置かれた第1の波長フィルタ24aと第1の検出素子25a、第2の光路に置かれた第2の波長フィルタ24bと第2の検出素子25bを備えている。第1の波長フィルタ24aは、12CO、の吸収を測定するため約4280nmの波長の赤外線を通し(バンド幅約20nm)、第2の波長フィルタ24bは、13CO、の吸収を測定するため約4412nmの波長の赤外線を通すように設計されている(バンド幅約50nm)。第1の検出素子25a、第2の検出素子25bは赤外線を検出する素子であれば任意のものでよく、例えばPbSe30といった半導体赤外センサが使用される。

【0021】第1の波長フィルタ24a、第1の検出素子25aは、Ar等の不活性ガスで満たされたバッケージ26aの中に入っており、第2の波長フィルタ24b、第2の検出素子25bも、同じく不活性ガスで満たされたパッケージ26bの中に入っている。赤外線検出装置Dの全体はヒータ及びベルチェ素子27により一定温度(25°C)に保たれ、パッケージ26a,26bの中の検出素子の部分はベルチェ素子により0°Cに保たれている。

【0022】セル室11は、それ自体ステンレス製であり、ヒータ13により上下又は左右が挟まれている。セル室11の中は、2段に分かれ、一方の段には第1サンブルセル11aと、リファレンスセル11cとが配置され、他方の段には第2サンブルセル11bが配置されている。第1サンプルセル11a及びリファレンスセル11cには第1の光路が直列に通り、第2サンプルセル11bには第2の光路が通っている。符号15、16、17は、赤外線を透過させるサファイヤ透過窓である。

【0023】前記セル室11は、ヒータ13により一定 50 ように、バルブV,を開き、呼気バッグより、サンプル

温度 (40°C) に保たれるよう制御されている。 III. 測定手順

測定では、ベースガスのCO、濃度とサンブルガスのCO、濃度とをほぼ一致させるため、まず予備測定において、ベースガスのCO、濃度と、サンブルガスのCO、濃度をそれぞれ測定し、本測定において、予備測定されたベースガスのCO、濃度が予備測定されたサンブルガスのCO、濃度よりも高ければ、とのベースガスのCO、濃度がサンブルガスのCO、濃度に等しくなるまでベースガスを希釈した後、ベースガスの濃度を測定し、その後サンブルガスの濃度を測定する。

【0024】もし本測定において、予備測定されたベースガスのCO、濃度が予備測定されたサンプルガスのCO、濃度よりも低ければ、ベースガスの濃度をこのまま測定し、サンプルガスのCO、濃度がベースガスのCO、濃度に等しくなるまでサンプルガスを希釈した後、サンプルガスのCO、濃度を測定する。測定は、リファレンスガス測定→ベースガス予備測定→リファレンスガス測定→ロファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→コファレンスガス測定→・・・・という手順で行う。

III -1. ベースガス予備測定

同位体ガス分光測定装置のガス流路及びセル室 1 1 に、 清浄なリファレンスガスを流してガス流路及びセル室 1 1の洗浄をするとともに、リファレンス光量の測定をす る。

【0025】具体的には、図2(a) に示すように、三方バルブV、をセル室11側に開き、バルブV、を開き、ガス注入器21でリファレンスガスを吸い込み、バルブ V_1 を閉じてガス注入器21でリファレンスガスを吐き出して、第1サンブルセル11aと第2サンブルセル11bを洗浄する。なお、リファレンスセル11cにはリファレンスガスを常時流し放しにする。

【0026】次に、図2(b) に示すように、バルブV, を開き、呼気バッグより、ベースガスをガス注入器21で吸い込み、ガス注入器21を用いてベースガスを一定流量で機械的に押し出す。この間、検出素子25aにより、ベースガスの光量測定をし、その吸光度により検量線を用いてCO、濃度を求めておく。

40 III - 2. サンプルガス予備測定

同位体ガス分光測定装置のガス流路及びセル室11に、 清浄なリファレンスガスを流してガス流路及びセル室1 1の洗浄をするとともに、リファレンス光量の測定をす ス

【0027】具体的には、図2(c) に示すように、バルブV、を開き、ガス注入器21でリファレンスガスを吸い込み、バルブV、を閉じてガス注入器21でリファレンスガスを吐き出して、第1サンプルセル11aと第2サンプルセル11bを洗浄する。次に、図2(d) に示すように、バルブV、を聞き、呼気バッグより、サンプル

ガスをガス注入器21で吸い込み、ガス注入器21を用 いてサンブルガスを一定流量で機械的に押し出す。この 間、検出素子25aにより、サンブルガスの光量測定を し、その吸光度により検量線を用いてCO、濃度を求め ておく。

III - 3. リファレンス測定

次に、ガス流路を変えてリファレンスガスを流し、ガス 流路及びセル室11の洗浄をする。約30秒経過後、そ れぞれの検出素子25 a, 25 b により、光量測定をす

【0028】具体的には、図3(a) に示すように、バル ブV, を開き、ガス注入器21でリファレンスガスを吸 い込み、バルブV, を閉じてガス注入器21でリファレ ンスガスを吐き出して、第1サンプルセル11aと第2 サンプルセル111bを洗浄する。この間、検出素子25 a, 検出素子25bにより、リファレンスガスの光量測 定をする。第1の検出素子25aで得られた光量を1'R 1、第2の検出素子25bで得られた光量を13R1と書 く。

III - 4. ベースガス測定

「III -1. ベースガス予備測定」において第1の検出 素子25aで得られたベースガスのCO、濃度と、「II Ⅰ-2. サンプルガス予備測定」において第1の検出素 子25 a で得られたサンプルガスのCO、濃度とを比較 し、ベースガスのCO、濃度がサンプルガスのCO、濃 度より濃い場合、ガス注入器21の中でベースガスのC O、濃度とサンプルガスのCO、濃度とが等しい割合に なるまでベースガスを空気で希釈した後、ベースガスの 光量測定をする。

【0029】具体的には、図3(b) に示すように、三方 30 バルブV。を大気側に開き、ガス注入器21で空気を所 定量吸い込む。次に、図3(c)に示すように、三方バル ブV、をセル室側に開き、バルブV、を開いてガス注入 器21でベースガスを吸い込み、空気と混合する。この ように希釈するので、2種類の呼気についてCO、濃度 をほぼ同じにできるから、1200、の検量線や1300、 の検量線を使う範囲を狭くすることができる。

【0030】なお、本実施形態の測定手順では、2種類 の呼気についてCO、濃度をほぼ同じにするところに意 味があり、特公平4-12414号公報に記載されてい 40 るようなCO、濃度を常時一定値に保つ手順は必ずしも 採用する必要はないことに注意すべきである。ベースガ スとサンプルガスとのCO、濃度を同じにできれば、検 量線を使う範囲を狭くするという目的を十分達成すると とができるからである。実際の測定によればベースガス やサンプルガスのCO、濃度は、1%から5%とバラツ キがあるので、CO、濃度を常時一定値に保つことは非 常に手間がかかる。

【0031】もしベースガスのCO、濃度がサンプルガ

いでとのベースガスをそのまま測定する。測定は、ガス 注入器21を用いてベースガスを一定流量で機械的に押 し出し、この間、それぞれの検出素子25a, 25bに より行う。このようにして、第1の検出素子25 aで得 られた光量を1'B、第2の検出素子25bで得られた光 量を13Bと書く。

8

III -5. リファレンス測定

再び、図3(d) に示すように、ガス流路及びセルの洗浄 と、リファレンスガスの光量測定をする。

【0032】とのようにして、第1の検出素子25aで 10 得られた光量1'R, 、第2の検出素子25bで得られた 光量13R、と書く。

III - 6. サンプルガス測定

「III - 4. ベースガス測定」でベースガスを希釈した 場合は、図3(e) に示すように、呼気バッグよりサンプ ルガスを吸い込んだ後、ガス注入器21を用いてサンプ ルガスを一定流量で機械的に押し出し、この間、それぞ れの検出素子25a, 25bにより、光量測定をする。 【0033】「III - 4. ベースガス測定」でベースガ 20 スを希釈していない場合は、ガス注入器21の中でサン プルガスのCO、濃度とベースガスのCO、濃度とが等 しい割合になるまでサンプルガスを空気で希釈した後、 それぞれの検出素子25a, 25bにより、サンブルガ スの光量測定をする。このようにして、第1の検出素子 25 aで得られた光量を1'S、第2の検出素子25bで 得られた光量を13Sと書く。

III - 7. リファレンスガス測定

再び、ガス流路及びセルの洗浄と、リファレンスガスの 光量測定をする。

【0034】とのようにして、第1の検出素子25aで 得られた光量1'R, 、第2の検出素子25bで得られた 光量¹³R」と書く。

IV. データ処理

IV-1. ベースガスの吸光度の算出

まず、前記測定手順で得られたリファレンスガスの透過 光量1'R₁、1'R₁、ベースガスの透過光量1'B、

13B、リファレンスガスの透過光量12R。、13R2を使 って、ベースガスにおける¹¹CO,の吸光度¹²Abs(B) と、13CO₂の吸光度13Abs(B) とを求める。

【0035】 ことで1'CO, の吸光度1'Abs(B) は、 12 A bs(B) = $-\log(2^{12}$ B/ $(^{12}$ R₁ $+^{12}$ R₂)) で求められ、¹¹CO』の吸光度¹³Abs(B)、

 13 A bs(B) = $-\log(2^{13}$ B/ $(^{13}$ R₁ $+^{13}$ R₂)) で求められる。

【0036】このように、吸光度を算出するときに、前 **後で行ったリファレンス測定の光量の平均値(R + R** 、)/2をとり、その平均値と、ベースガス測定で得ら れた光量とを用いて吸光度を算出しているので、ドリフ ト(時間変化が測定に影響を及ぼすこと)の影響を相殺 スのCO、濃度より薄い場合は、ベースガスを希釈しな 50 することができる。したがって、装置の立ち上げ時に完

全に熱平衡になるまで(通常数時間かかる) 待たなくて も、速やかに測定を始めることができる。

IV-2. サンプルガスの吸光度の算出

次に、前記測定手順で得られたリファレンスガスの透過 光量¹² R₂、¹³ R₂、サンプルガスの透過光量¹² S、¹³ S、リファレンスガスの透過光量¹² R₃、¹³ R₃を使って、サンブルガスにおける¹² CO₂の吸光度¹³ A bs(S) とを求める。

【0037】 ことで¹²CO₂の吸光度¹²Abs(S)は、
¹²Abs(S) = - log〔2¹²S/(¹²R₂+¹²R₃)〕
で求められ、¹³CO₂の吸光度¹³Abs(S)は、
¹³Abs(S) = - log〔2¹³S(¹³R₂+¹³R₃)〕
で求められる。

【0038】このように、吸光度を算出するときに、前後で行ったリファレンス測定の光量平均値をとり、その平均値と、サンプルガス測定で得られた光量とを用いて吸光度を算出しているので、ドリフトの影響を相殺することができる。

IV-3. 濃度の算出

検**量線を使って、12 C O 2 の**濃度と13 C O 2 の濃度を求 20 める

【0039】検量線は、''CO、濃度の分かっている被測定ガスと、''CO、濃度の分かっている被測定ガスを用いて、作成する。検量線を作成するには''CO、濃度を0%~6%程度の範囲で変えてみて、''CO、の吸光度を測定する。 横軸を''CO、濃度にとり、縦軸を''CO、吸光度にとり、プロットし、最小自乗法を用いて曲線を決定する。 2次式で近似したものが、比較的誤差の少ない曲線となったので、本実施形態では、2次式で近似した検量線を採用している。

【0040】また、13CO、濃度を0.00%~0.07%程度の範囲で変えてみて、12CO、の吸光度を測定する。横軸を13CO、濃度にとり、縦軸を13CO、吸光度にとり、プロットし、最小自乗法を用いて曲線を決定する。2次式で近似したものが、比較的誤差の少ない曲線となったので、本実施形態では、2次式で近似した検量線を採用している。

【0041】なお厳密にいうと、''CO」の入っているガスと、''CO」の入っているガスをそれぞれ単独で測定するのと、''CO」と''CO」とが混合しているガスを測定するのでは、''CO」の吸火スペクトルと''CO」の吸収スペクトルとが一部重なっていることによる。本測定では、''CO」とが混合しているガスを測定対象とするので、検量線を決定するときに前記重なり分を補正しておく必要がある。本測定では実際、吸収スペクトルの一部重なりを補正した検量線を採用している。

【0042】前記検量線を用いて求められた、ベースガ 吸い込み、ベースガスを吸い込んだ後、一定速度で機械スにおける1202の濃度を12conc(B)、ベースガスに 50 的に押し出すときのガス流路を示す図である。(e) は呼

おける¹¹CO,の濃度を¹¹Conc(B)、サンプルガスにおける¹²CO,の濃度を¹²Conc(S)、サンプルガスにおける¹¹CO,の濃度を¹³Conc(S)と書く。

IV-4. 濃度比の算出

13 CO, と12 CO, との濃度比を求める。ベースガスにおける濃度比は、

¹³ Conc(B) / ¹² Conc(B)

サンプルガスにおける濃度比は、

13 Conc(S) /12 Conc(S)

10 で求められる。

【 0 0 4 3 】なお、濃度比は、¹³Conc(B) / [¹²Conc(B) + ¹³Conc(B)], ¹³Conc(S) / [¹²Conc(S) +¹³Conc(S)] と定義してもよい。¹²CO, の濃度のほうが¹³CO,の濃度よりはるかに大きいので、いずれもほぼ同じ値となるからである。

IV-5. 13 Cの変化分の決定

サンブルガスとベースガスとを比較した¹¹Cの変化分は次の式で求められる。

【0044】△¹³C=〔サンブルガスの濃度比−ベースガスの濃度比〕×10³/〔ベースガスの濃度比〕 (単位: パーミル(千分率))

[0045]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、呼気の成分ガスの構成を変えないように希釈することによって、2種類の被測定ガスについてCO、濃度をほぼ同じにできるから、''CO、の検量線や''CO、の検量線を使う範囲を狭くすることができる。検量線は、使う範囲が狭いほど、精度のよいものが得られるので、検量線を使う範囲を限定することによって、測定精度を向上させることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】同位体ガス分光測定装置の全体構成を示すブロック図である。

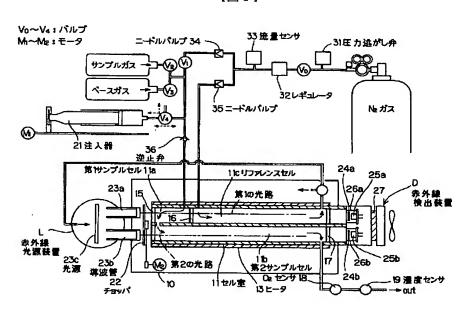
【図2】同位体ガス分光測定装置のガス流路を示す図である。(a) 及び(c) はセル室に清浄なリファレンスガスを流して洗浄するときのガス流路を示す図である。(b) は呼気バッグより、ベースガスをガス注入器21で吸い込み、ベースガスを吸い込んだ後、一定速度で機械的に押し出すときのガス流路を示す図である。(d) は呼気バッグより、サンブルガスをガス注入器21で吸い込み、サンブルガスを吸い込んだ後、一定速度で機械的に押し出すときのガス流路を示す図である。

【図3】同位体ガス分光測定装置のガス流路を示す図である。(a) 及び(d) はセル室に清浄なリファレンスガスを流して洗浄するときのガス流路を示す図である。(b) は三方バルブV. を大気側に開き、ガス注入器21で空気を所定量吸い込むときのガス流路を示す図である。(c) は呼気バッグより、ベースガスをガス注入器21で吸い込み、ベースガスを吸い込んだ後、一定速度で機械

11

気バッグより	、サンプルガスをガス注入器21で吸い込	*	1 8	O』センサ
み、サンプル	<i>対ス</i> を吸い込んで混合し、一定速度で機械		19	湿度センサ
的に押し出す	こときのガス流路を示す図である。		2 1	ガス注入器
【符号の説明	1)		24 a	第1の波長フィルタ
D 赤	外線検出装置		24 b	第2の波長フィルタ
L 赤	外線光源装置		25 a	第1の検出素子
M_1 , M_2	モータ		25 b	第2の検出素子
V_0 , V_1 ~	-V。 バルブ		3 1	圧力逃がし弁
11 t	2ル室		3 2	レギュレータ
lla 第	፤ 1 サンプルセル	10	3 3	流量計
11b 第	32サンプルセル		3 5	ニードルバルブ
11c リ	ファレンスセル	*	36	逆止弁

【図1】



[図2]

